

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ястребов Олег Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 29.05.2024 10:51:14
Уникальный программный ключ:
План одобрен Ученым советом ОУП
ca255a012008510831959875078e1fa989dae18a
Протокол № 2022-08/23-11/3 от 29.11.2023

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
Инженерная академия

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор - проректор по образовательной
деятельности

_____ Эбзеева Ю.Н.

"__" _____ 20__ г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

по программе магистратуры

28.04.01

Нанотехнологии и микросистемная техника
Инженерно-физические технологии в nanoиндустрии

Кафедра: Базовая кафедра "Нанотехнологии и микросистемная техника"

Факультет: Инженерная академия

Квалификация: магистр

Год начала подготовки (по учебному плану) 2024

Форма обучения: Очная

Образовательный стандарт (СУОС) ОС ВО РУДН №371 от 21.05.2021

Срок получения образования: 2 г.

Типы задач профессиональной деятельности

научно-исследовательский

проектно-технологический

СОГЛАСОВАНО

Начальник УОП _____ / Воробьева А.А./

Директор академии _____ / Разумный Ю.Н./

Председатель МССН _____ / Агасиева С.В./

Руководитель ОП ВО _____ / Агасиева С.В./

-	-	-	з.е.	Итого акад.ча	Курс 1								Курс 2							
					Семестр 1 [18 нед]				Семестр 2 [17 нед]				Семестр 3 [18 нед]				Семестр 4 [нед]			
Считать в плане	Индекс	Наименование	Факт	По плану	з.е.	Лек	Лаб	Пр	з.е.	Лек	Лаб	Пр	з.е.	Лек	Лаб	Пр	з.е.	Лек	Лаб	Пр
Блок 1.Дисциплины (модули)			81	2916	30	144	18	144	24	119	51	119	27	162	36	108				
Обязательная часть			69	2484	30	144	18	144	19	85	51	102	20	108	36	72				
+	Б1.О.01	Базовая компонента	19	684	9	2		4	8	2		4	2			2				
+	Б1.О.01.01	Иностранный язык в профессиональной деятельности	6	216	2			2	2			2	2			2				
+	Б1.О.01.02	История и методология науки	2	72					2	1		1								
+	Б1.О.01.03	Основы применения нанотехнологий и микросистемной техники	6	216	2	1			4	1		1								
+	Б1.О.01.04	Введение в микро- и наноэлектромеханические системы	5	180	5	1		2												
+	Б1.О.02	Вариативная компонента	50	1800	21	6	1	4	11	3	3	2	18	6	2	2				
+	Б1.О.02.01	Технологии программирования в nanoиндустрии	8	288	4	1	1		4	1	2									
+	Б1.О.02.02	Квантовая механика в наносистемах	6	216	6	2		2												
+	Б1.О.02.03	Аддитивные технологии	4	144	4	1		1												
+	Б1.О.02.04	Материалы наноструктурных установок	7	252	7	2		1												
+	Б1.О.02.05	Оптические измерения	7	252									7	2	2					
+	Б1.О.02.06	Надежность устройств нанoeлектронной и микросистемной техники	5	180					5	2		2								
+	Б1.О.02.07	Технология нанесения тонких пленок	4	144									4	2		1				
+	Б1.О.02.08	Диагностические системы в нанотехнологиях	7	252									7	2		1				
+	Б1.О.02.09	Modeling of nanoobjects	2	72					2		1									
Часть, формируемая участниками образовательных			12	432					5	34		17	7	54		36				
+	Б1.В.ДВ.01	Элективные дисциплины	5	180					5	2		1								
+	Б1.В.ДВ.01.01	Технология изготовления устройств nano- и микросистемной техники	5	180					5	2		1								
-	Б1.В.ДВ.01.02	Технология производства нанoeлектронных устройств	5	180					5	2		1								
+	Б1.В.ДВ.02	Элективные дисциплины	2	72									2	1		1				
+	Б1.В.ДВ.02.01	Создание инновационного продукта	2	72									2	1		1				
-	Б1.В.ДВ.02.02	Design of innovative product / Создание инновационного продукта	2	72									2	1		1				
+	Б1.В.ДВ.03	Элективные дисциплины	5	180									5	2		1				
+	Б1.В.ДВ.03.01	Технологии производства оптоэлектронной базы	5	180									5	2		1				

